한국경제TV (Korea)

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution - January 20, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. Supporting wafer sizes up to 300 mm and featuring high-precision alignment, advanced process control and high throughput, the EVG7300 meets the high-volume manufacturing needs for a variety of freeform and high-precision nano- and micro-optical components and devices.

EV그룹, 다기능 마이크로·나노임프린트 솔루션 출시

EV그룹(이하 EVG)가 자동화된 SmartNIL® 나노임프린트 및 웨이퍼 레벨 광학 시스템 EVG®7300을 출시한다.

나노임프린트 리소그래피(NIL), 렌즈 몰딩 및 렌즈 스대킹 같은 UV 기반의 여러 프로세스를 단일 플랫폼에 결합 가능한 EVG7300은 마이크로와 나노 패터닝은 넓은 신규 애플리케이션의 첨단 R&D, 생산 공정에 사용된다.

이러한 애플리케이션 사례에는 웨이퍼 레벨 광학(WLO), 광학 센서와 프로젝터, 차량용 조명, 증강 현실(AR) 헤드셋용 웨이브가이드, 바이오 의료 장비, 메타 렌즈와 메타 표면, 광전자 기기 등이 포함된다. 최대 300mm 웨이퍼를 지원하고 고정밀 얼라인먼트, 향상된 프로세스 제어, 우수한 쓰루풋 성능까지 갖추고 있다.

Source: EV Group (EVG)

EV그룹 토마스 글린스너(Thomas Glinsner) 디렉터는 "20년 이상의 나노임프린트 기술 경험을 바탕으로 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 노력해왔으며 최신 솔루션인 EVG7300은 정밀한 얼라인먼트와 공정 파라미터 제어가 특징이다"고 설명했다.

EVG7300은 독립된 툴 또는 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션에 하나의 모듈로 통합해 사용 가능하다. 이로 인해 세정과 레지스트 코팅 및 베이킹 같은 전?후 처리 공정이 가능하다. 또한 신속한 스탬프와 웨이퍼 로딩, 고속 얼라인먼트 광학계, 고전력 경화 등 새롭게 떠오르는 WLO제품의 제조에 효율적이다.

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202201200110&t=NN